

執筆者紹介

大貫 仁(おおぬき じん)

茨城大学名誉教授, 新電元工業株式会社参与

1974年 東北大学大学院工学研究科金属材料工学専攻修士課程修了
工学博士

篠嶋 妥(ささじま やすし)

茨城大学大学院理工学研究科教授

1986年 東京大学大学院工学系研究科金属材料工学専攻修士課程修了
博士(工学)

永野 隆敏(ながの たかとし)

茨城大学大学院理工学研究科講師

東京都立大学法人 東京都立産業技術高等専門学校
非常勤講師

2001年 明治大学大学院理工学研究科機械工学専攻博士後期課程修了
博士(工学)

稲見 隆(いなみ たかし)

元茨城大学工学部准教授

1975年 茨城大学大学院工学研究科修士課程修了
博士(工学)

2021年4月20日 第1版発行

著者の了解に
より検印を省
略いたします

著者◎ 大貫 仁
篠嶋 妥
永野 隆敏
稲見 隆

半導体デバイスにおける界面制御技術
固体界面物性と計算機実験の基礎と応用

発行者 内田 学
印刷者 馬場 信幸

発行所 株式会社 内田老鶴堂 〒112-0012 東京都文京区大塚3丁目34番3号
電話 03(3945)6781(代)・FAX 03(3945)6782
<http://www.rokakuho.co.jp/> 印刷・製本/三美印刷 K. K.

Published by UCHIDA ROKAKUHO PUBLISHING CO., LTD.
3-34-3 Otsuka, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan

ISBN 978-4-7536-5050-7 C3042

U. R. No. 661-1